



- (51) 국제특허분류:
F16B 47/00 (2006.01) *A47K 10/18* (2006.01)
A47K 10/04 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2010/008112
- (22) 국제출원일: 2010년 11월 16일 (16.11.2010)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (71) 출원인 (US 을(를) 제외한 모든 지정국에 대하여): (주) 엠에스인텍 (MS INTECH CO., LTD.) [KR/KR]; 서울시 금천구 가산동 345-9 SK 트윈타워 B동 305, 306 호, 153-802 Seoul (KR).
- (72) 발명자: 권
- (75) 발명자/출원인 (US 에 한하여): 우철석 (WOO, Chul Seok) [KR/KR]; 서울시 양천구 목동 917 번지 목동 파라곤 109-201, 158-050 Seoul (KR).
- (74) 대리인: 김영환 (KIM, Yuong Hwan); 서울 금천구 가산동 550-1 IT 캐슬 1-308, 153-768 Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

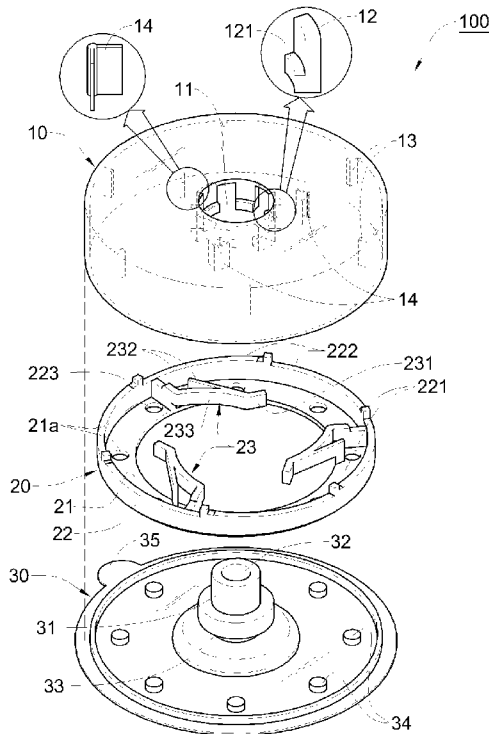
(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[다음 쪽 계속]

(54) Title: VACUUM ADSORBING DEVICE

(54) 발명의 명칭 : 진공 흡착기

[Fig. 2]



(57) Abstract: A vacuum adsorbing device of the present invention comprises: a cover which is rotatably mounted on the upper portion so as to couple to a flat surface by means of vacuum adsorption; an adsorption plate, which is coupled to the lower portion of the cover, for vacuum adsorbing to the flat surface; and a height adjustment member, which is arranged between the cover and the adsorption plate, for moving the adsorption plate back and forth according to the rotation of the cover; wherein a plurality of fixing pieces are formed on the upper surface of the inside of the cover, a plurality of elastic stoppers are coupled to the inside of the height adjustment member, so as to be movable by sliding when each of the fixing pieces is in contact, and for fixing the cover by each of the fixing pieces being hooked to the end portion of the cover so as to prevent reverse rotation. The vacuum adsorbing device of the present invention enhances adsorption force so as to couple the vacuum adsorption device to the flat surface more solidly and for a longer time, enhances assembly between each of the elements for vacuum adsorption, and prevents unlocking due to outside shock by forming a double locking structure in the vacuum adsorption device.

(57) 요약서: 본 발명의 진공 흡착기는 편평한 평면에 진공 흡착방식으로 부착되도록

[다음 쪽 계속]

**공개:**

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

상부측에 회전가능하게 설치되는 덮개와, 상기 덮개의 하부에 결합되어 편평한 평면에 진공 흡착되는 흡착판과, 상기 덮개와 흡착판 사이에 설치되어 덮개의 회전에 따라 상기 흡착판을 왕복이동시키는 높이조절부재를 포함하고 있고, 상기 덮개의 내측 상면에는 복수개의 고정편이 형성되고, 상기 높이조절부재의 내측에는 상기 각 고정편이 접촉된 상태에서 슬라이딩 이동가능함은 물론 상기 덮개의 역회전 방지를 위해 상기의 각 고정편이 단부측에 걸려 덮개를 고정하도록 일정한 탄성력을 갖는 복수개의 탄성결립편이 결합된 것이다. 본 발명의 진공 흡착기는 흡착력을 향상시켜 상기의 진공 흡착기를 편평한 평면에 보다 견고하면서 오랫동안 부착되고, 상기 진공 흡착의 각 구성간의 조립성이 향상되며, 진공 흡착기의 잠금구조를 이중으로 형성함에 따라 외부에서 가해지는 충격에도 잠금구조가 풀리는 현상을 방지한 것이다.